

Mesure de topographie de surfaces par interférométrie en lumière blanche

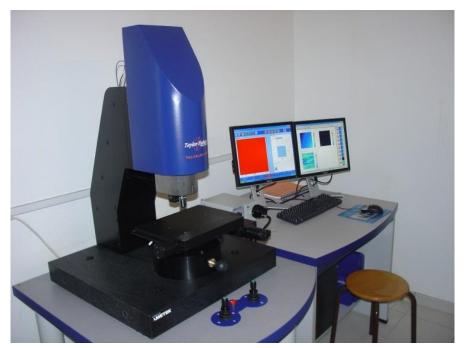
N. Brunetière

Institut P' • UPR CNRS 3346 SP2MI • Téléport 2 Boulevard Marie et Pierre Curie • BP 30179 F86962 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex





Introduction



2004: Détection d'un besoin pour la mesure rapide de topographie3D de surface (tribologie, matériaux, physique, etc)

2005: - Prospection

- Financement XIICPER

2006: Achat d'un microscope interférométrique à lumière blanche (Taylor Hobson CCI 6000 > 165 k€)

Présentation des possibilités du microscope



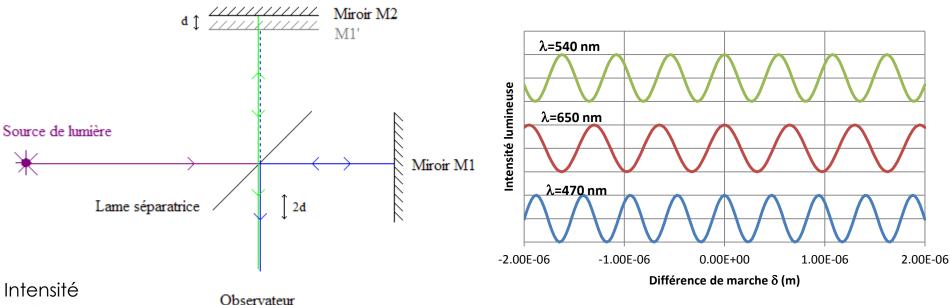
Plan

- Introduction
- Rappels d'interférométrie
- Mesure d'altitude
- Caractéristiques du microscope
- Exemples d'application
- Conclusion



Rappels d'interférométrie

• Lumière monochromatique



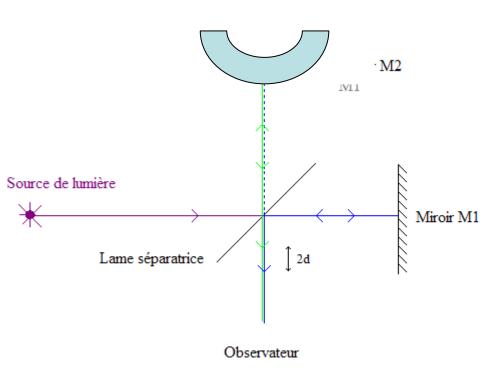
Intensité *lumineuse* observée

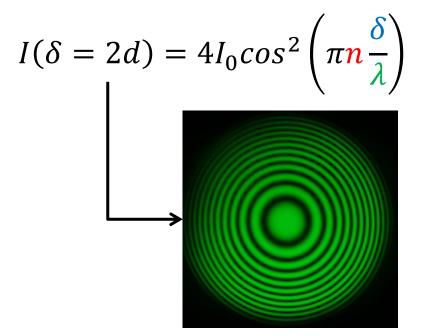
$$I(\delta=2d)=4I_0cos^2\left(\pi n \frac{\delta}{\lambda}\right)$$
 Différence de marche Indice de réfraction du milieu (air, n=1) Longueur d'onde de la source



Rappels d'interférométrie

• Lumière monochromatique

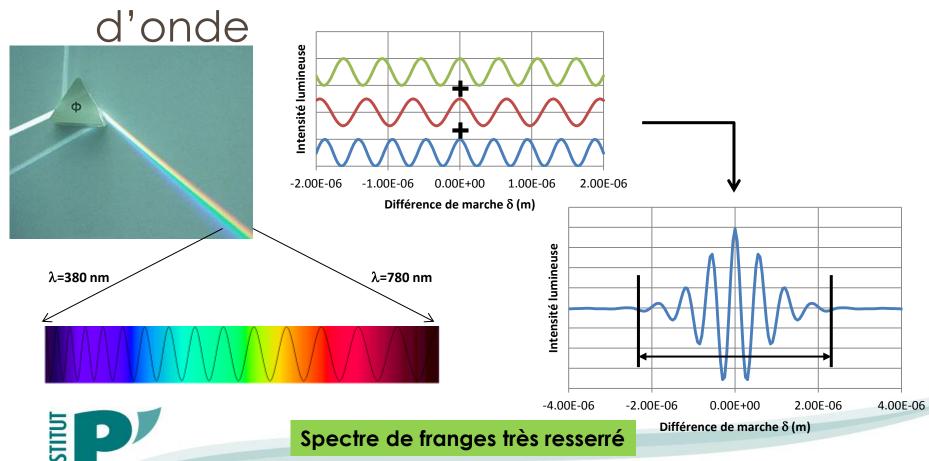




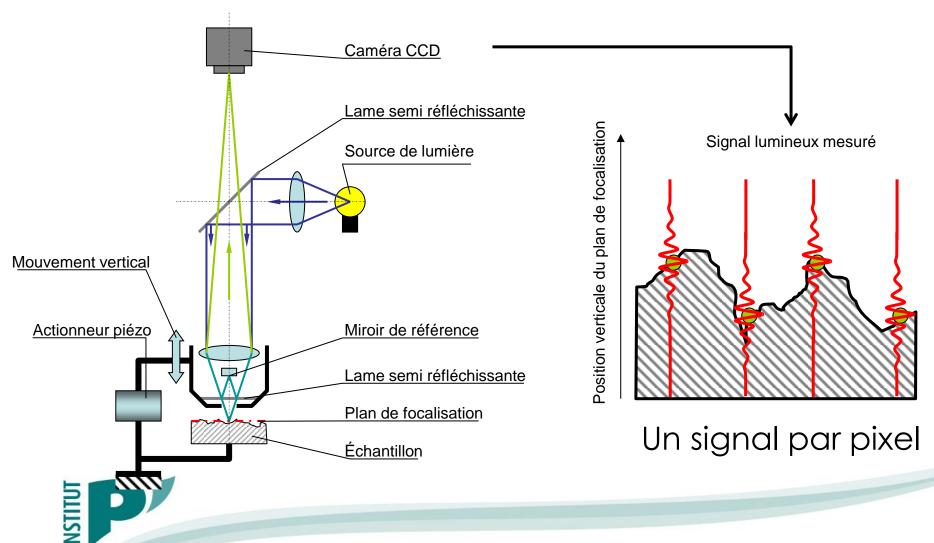


Rappels d'interférométrie

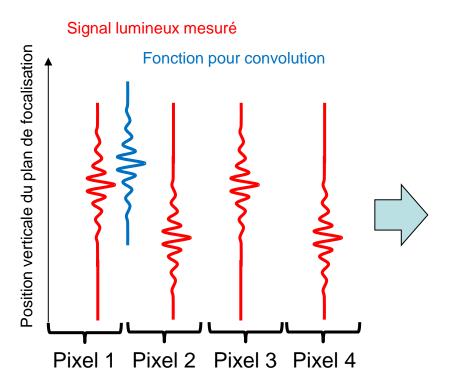
• Lumière blanche: spectre de longueurs

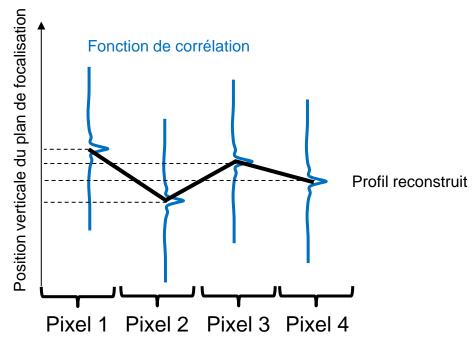


Mesure d'altitude



Mesure d'altitude



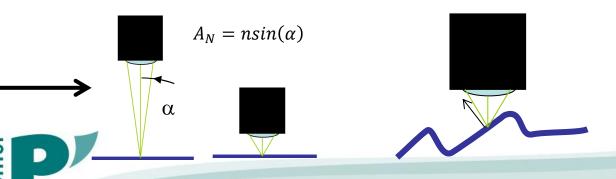




Caractéristiques du microscope

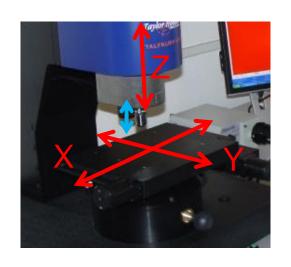
Caméra CCD N&B 1024x1024 (Low noise)

Objectif	Champ de vision (µm)	Ech. latéral (µm)	Limite latéral, Sparrow (µm)	Distance de travail (mm)	A _N	Angle max(°)	
5X	3600	3.6	2.12	9.3	0.13	3.5	Surface lisse
10X	1800	1.8	0.92	7.4	0.30	8	
20X	900	0.9	0.69	4.7	0.40	14.5	
50X	360	0.36	0.50	3.6	0.55	22	Surface rugueuse



Caractéristiques du microscope

• Etendue de mesure



Amplitude piezo: 250 µm

Recollement d'images

Table motorisée X Y: 150x150 mm

Tête motorisée Z: 100 mm

Résolution verticale (tous les objectifs)

Résolution ~ 0.01nm Précision ~ 10^{-4} à 10^{-3} amplitude du scan

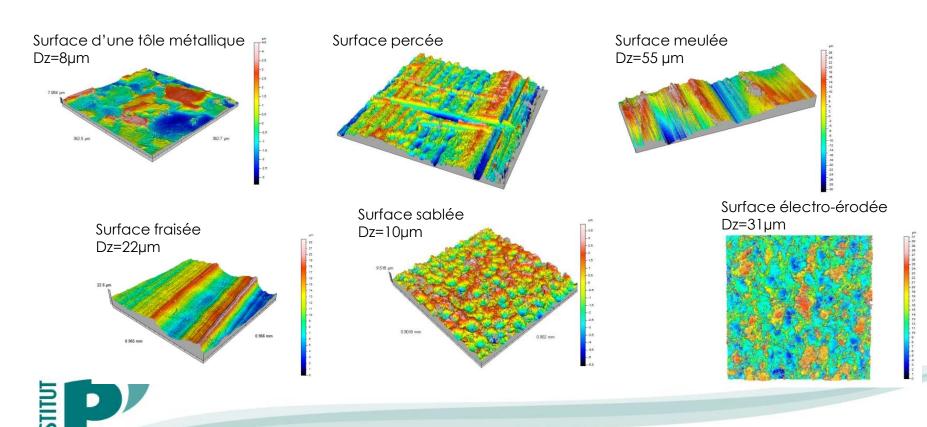


Caractéristiques du microscope

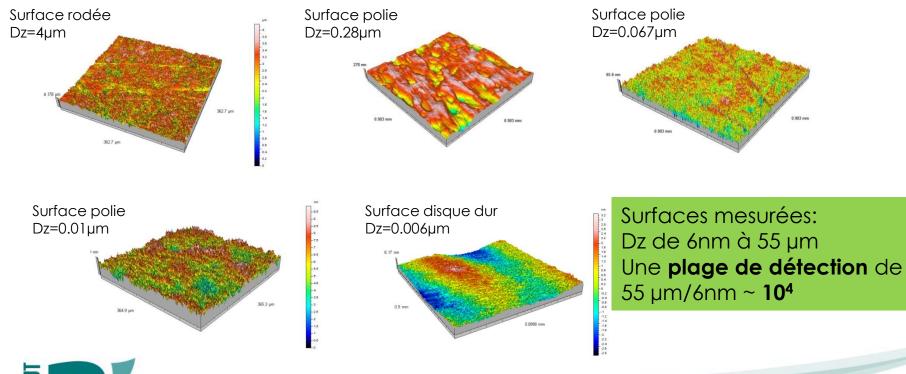
- Calibrations du microscope
 - Z: mesure d'une marche étalon (5 ou 50µm)
 - X, Y: mesure d'un cercle étalon
 - Miroir: plan étalon (x8)



Mesure d'état de surfaces



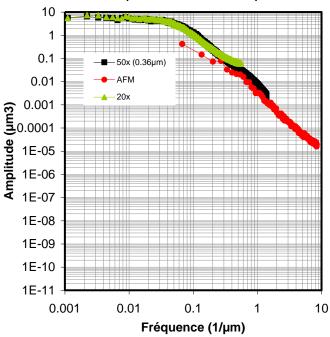
Mesure d'état de surfaces



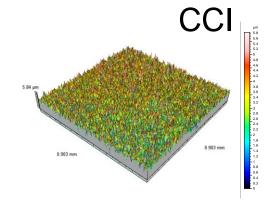


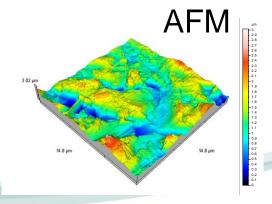
Mesure d'état de surface

Comparaison AFM – Interféromètre Densité spectrale de puissance



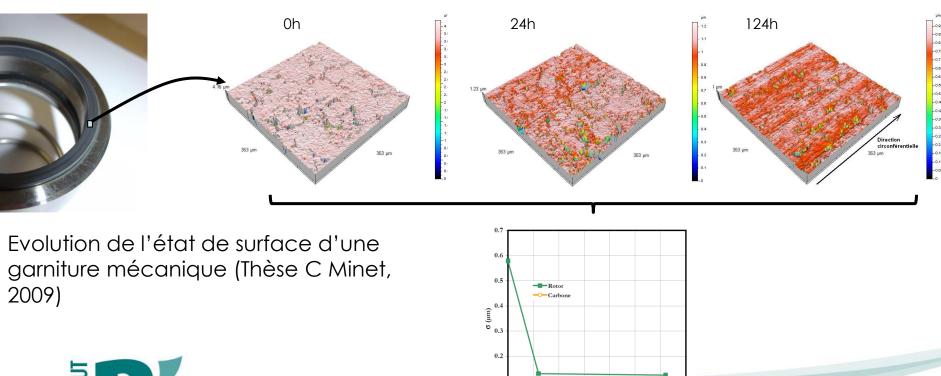
 $\sigma(20x) = 0.928 \mu m$ $\sigma(50x) = 0.919 \mu m$ $\sigma(AFM) = 0.369 \mu m$







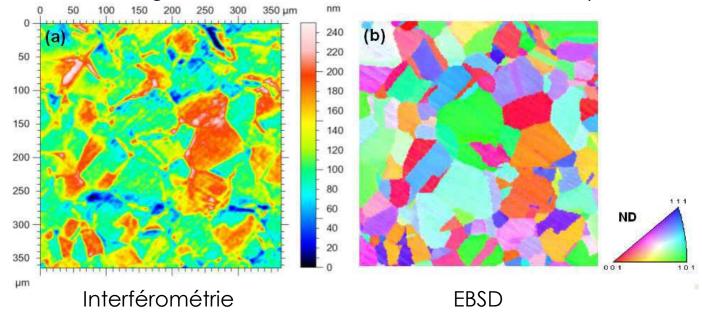
Etude tribologique





Etude matériaux

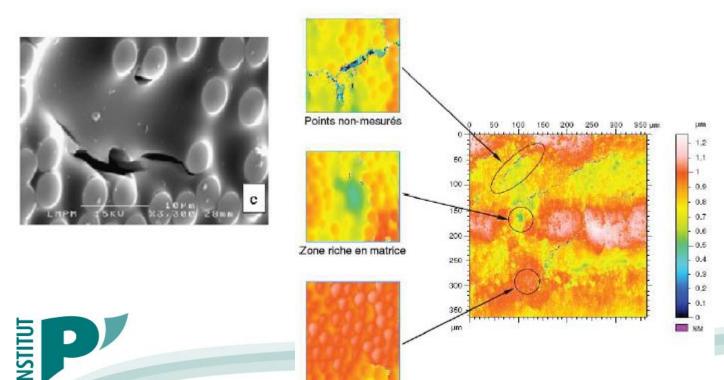
Gonflement des grains d'un acier inox lors de la nitruration (Thèse J-C Stinville, 2010)





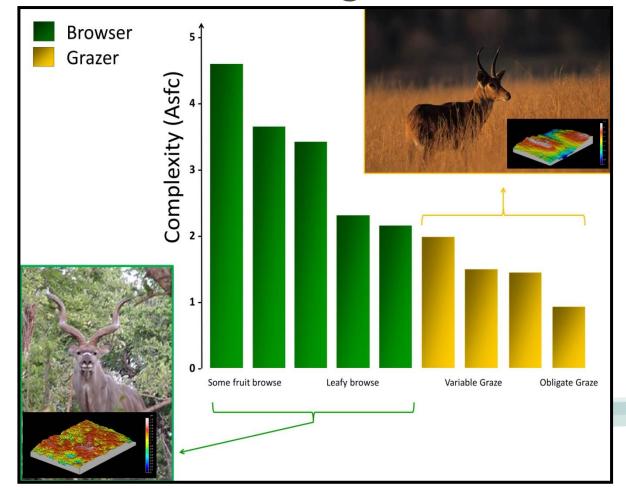
Etude matériaux

Thermo oxydation de matériaux composites (Gigliotti et al., 2009)



Zone dense en fibres

Paléontologie



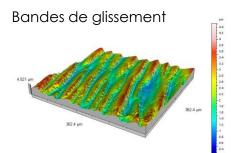
Surfaces dentaires: Reconstitution du régime alimentaire des fossiles Reconstitution de la flore locale

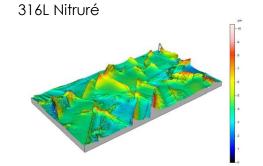
(G. Merceron, Iphep, 2012)

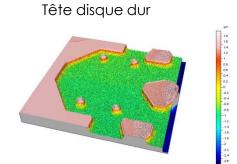
Conclusions

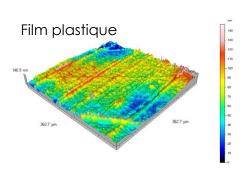
- Larges possibilités de mesure de surfaces:
 - X,Y: de 360 µm à 150mm
 - Z: de qq nm à 250 µm
 - Résolution X,Y ~ 1µm
 - Résolution Z < 1nm
- Ouvert à la communauté P' et scientifique (après formation)
- 66 utilisateurs, 83 personnes formées (D1, D2, D3, SiC, Iphep)
- 1380 utilisations (presque 1 par jour) et 13800 surfaces mesurées (au 17/5/2013)











Merci de votre attention

